## 半导体物理及固体物理基础

第三章: 载流子的统计分布



孙斌

Email: <a href="mailto:sunbin@suda.edu.cn/sb2">sunbin@suda.edu.cn/sb2</a>
<a href="mailto:http://web.suda.edu.cn/sb2">http://web.suda.edu.cn/sb2</a>

苏州大学 | 未来科学与工程学院

## 课程内容



- 半导体中的电子状态
  - 晶格结构
  - 能带
- 杂质和缺陷能级
  - 缺陷
  - 杂质能级
- 载流子的统计分布
  - 状态密度
  - 费米-狄拉克分布
  - 载流子浓度

- 半导体的导电性
  - 漂移
  - 扩散
- 非平衡载流子
  - 产生
  - 复合
- pn结和金属-半导体接触
  - 零偏
  - 反偏
  - 正偏



# 状态密度 (Density of States)

## 量子态密度



- > 能带中能级间隔很小,可以近似认为是连续的;
- ➤ 在能带中E~E+dE之间无限小的能量间隔内有dZ 个量子态,则量子态密度g(E)可以定义为:

$$g(E) = \frac{dZ}{dE}$$

#### 状态密度



#### 被三维无限深势阱束缚的电子:

$$V(x, y, z) = 0 \begin{cases} 0 < x < a \\ 0 < y < a \\ 0 < z < a \end{cases}$$

$$V(x, y, z) = \infty$$
 其它

$$\frac{2mE}{\hbar^2} = k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2\right) \left(\frac{\pi}{a}\right)^2$$



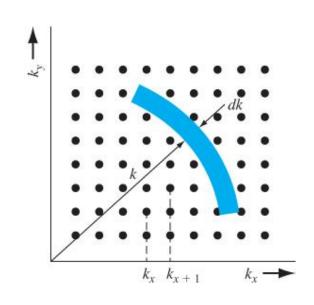
$$\frac{2mE}{\hbar^2} = k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2\right) \left(\frac{\pi}{a}\right)^2$$

一维方向上,两个量子态的间距:

$$k_{x+1} - k_x = \frac{\pi}{a}$$

一个量子态所占的空间 $V_k$ 为:

$$V_k = \left(\frac{\pi}{a}\right)^3$$





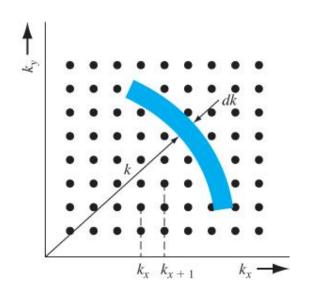
k空间体积微元为:

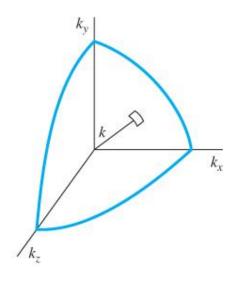
$$4\pi k^2 dk$$

k空间量子态的微元:

$$dZ = 2\left(\frac{1}{8}\right) \frac{4\pi k^2 dk}{\left(\frac{\pi}{a}\right)^3}$$

$$=\frac{a^3k^2}{\pi^2}dk$$







$$dZ = \frac{a^3}{\pi^2} \left(\frac{2mE}{\hbar^2}\right) dk$$

$$\left(k^{2} = \frac{2mE}{\hbar^{2}} \implies dk = \frac{1}{\hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}} dE\right)$$

$$dZ = \frac{4\pi a^3 (2m)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E} dE$$



体积为 $a^3$ 的晶体中E和E+dE之间的量子态总数:

$$dZ = \frac{4\pi a^3 \left(2m\right)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E} dE$$

体积为a3的晶体中单位能量之间的量子态总数:

$$g(E) = \frac{dZ}{dE} = \frac{4\pi a^3 (2m)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E}$$

单位体积单位能量之间的量子态密度:

$$g_c(E) = \frac{4\pi (2m)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E}$$



导带态密度:

$$g_c(E) = \frac{4\pi (2m_n^*)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \sqrt{E - E_c}$$

价带态密度:

$$g_{\nu}(E) = \frac{4\pi (2m_p^*)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \sqrt{E_{\nu} - E}$$

导带中某一能级上的电子数:

$$n(E) = g_c(E)f(E)$$

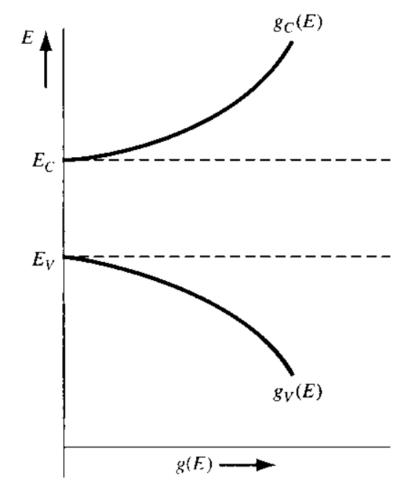
价带中某一能级上的空穴数:

$$p(E) = g_v(E) [1 - f(E)]$$

#### 状态密度小结



- 1) 态密度量纲
- 2) 原子密度, (量子) 态密度典型值
- 3) 导带态密度、价带态密度
- 4) 二维半导体的态密度





## 费米-狄拉克分布函数 (Fermi-Dirac Distribution Function)



#### 一个电子占据能量E的能态的几率:

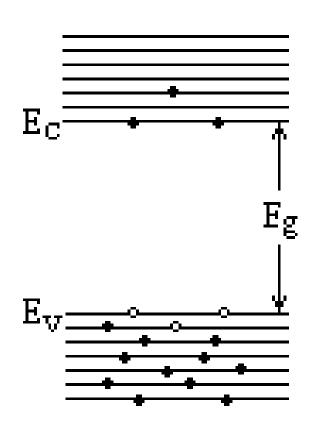
• 费米-狄拉克分布:

$$f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$

k: 玻尔兹曼常数 [J/K]

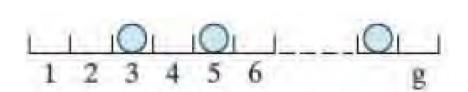
T: 绝对温度 [K]

E<sub>F</sub>: Fermi能级





数学推导1



在某一能级有g个量子态(假设每个量子态目前只能放一个电子)

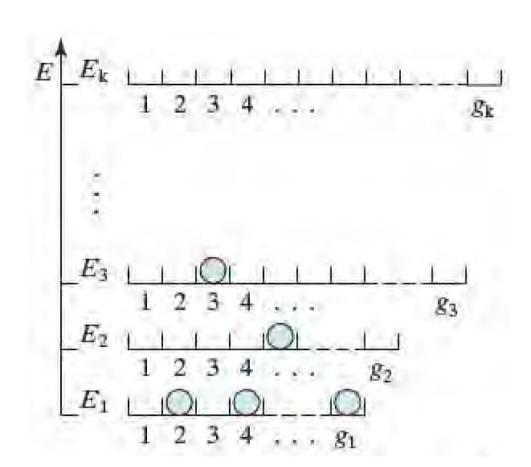
- 放第1个电子时有g种方法
- · 放第2个电子时有g-1种方法
- 放第3个电子时有g-2种方法
- 放第n个电子时有g-(n-1)种方法

由于电子属于<mark>费米子</mark>(粒子和粒子之间不可分辨),粒子本身之间的n!种排列是相同的,所以放置n个球的方法共有

$$W = \frac{g(g-1)(g-2)...[g-(n-1)]}{n!} = \frac{g!}{(g-n)!n!}$$



数学推导2



所以在能级 $E_i$ 中 $n_i$ 个电子的排列方式有:

$$W_i = \frac{g_i!}{(g_i - n_i)!n_i!}$$

在一共 k 个能级中所有的排列方式为:

$$W_{\text{total}} = W_1 \times W_2 \times ... \times W_k$$

比值 $n_i/g_i$ 是在能级 $E_i$ 处某一量子态被占据的概率,费米-狄拉克分布就是这个概率关于能量的函数f(E)。

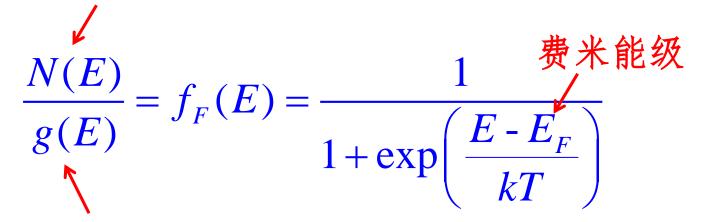
目标为在系统中的总电子数和总能量保持不变的前提下寻找 $W_{
m total}$ 的最大值(系统的熵最大):

$$\Sigma_k n_i = \text{constant}$$
  
 $\Sigma_k n_i E_i = \text{constant}$ 



- > 单个电子的能量是不断变化的;
- ▶ 从大量电子的整体来看,热平衡状态下, 电子按能量的大小,具有一定的统计分布规律。



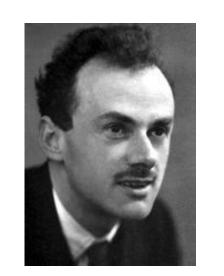


单位体积单位能量的量子状态数

费米能级的定义: 电子占据该能级的概率为50%



1938年Nobel





费米能级

将半导体中大量电子的整体看成一个热力学系统,根据统计理论,费米能级 $E_F$ 就是系统的化学势,即

$$E_F = \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_T$$
 F是系统的自由能。

公式的意义: 当系统处于热平衡状态, 也不对外做功的情况下, 系统中每增加一个电子所引起系统自由能的变化, 等于系统的化学势, 也就是系统的费米能级

处于热平衡状态的系统有统一的化学势,所以处于热平衡状态的电子系统有统一的费米能级。



绝对零度下, $E > E_{\rm F}$ 

$$f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$

$$T = 0K$$
  $kT = 0$ ,  $1/kT = \infty$ 

$$E > E_F$$
,  $E - E_F > 0$ ;  $\frac{E - E_F}{kT} = +\infty$ ,  $\exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right) = +\infty$ 

$$f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)} = 0$$



绝对零度下, $E < E_{\rm F}$ 

$$f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$

$$T = 0K$$
  $kT = 0$ ,  $1/kT = \infty$ 

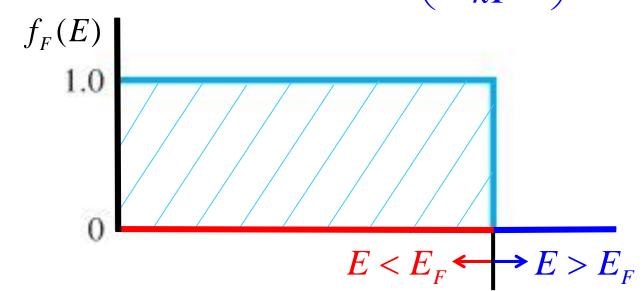
$$E < E_F$$
 ,  $E - E_F < 0$  ,  $\frac{E - E_F}{kT} = -\infty$  ,  $\exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right) = 0$ 

$$f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)} = 0$$



$$T = 0K$$

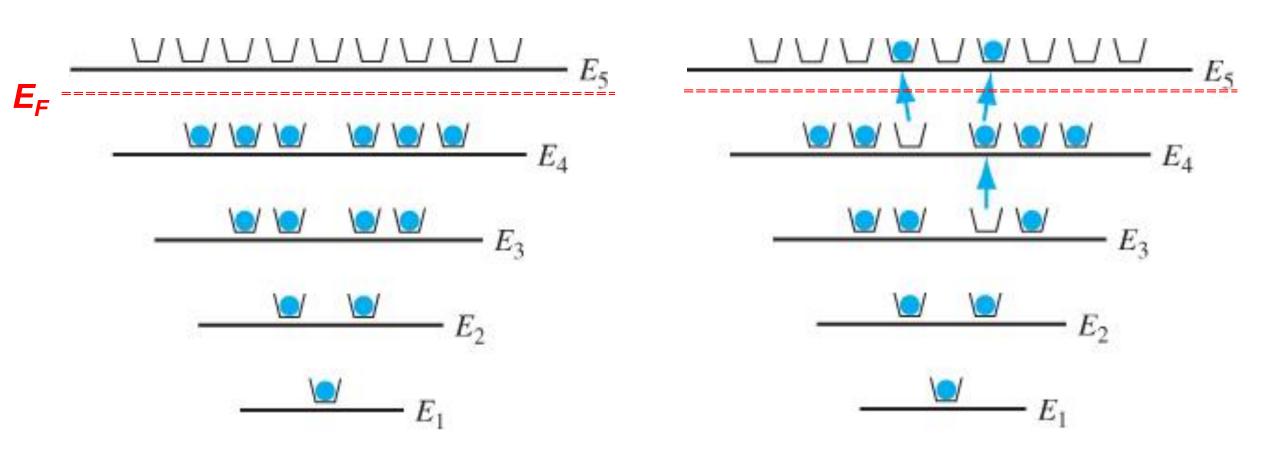
$$E < E_F$$
 ,  $\frac{E - E_F}{kT} = -\infty$  ,  $f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)} = 1$   $\Longrightarrow$   $\pm 7$   $\pm 2$ 





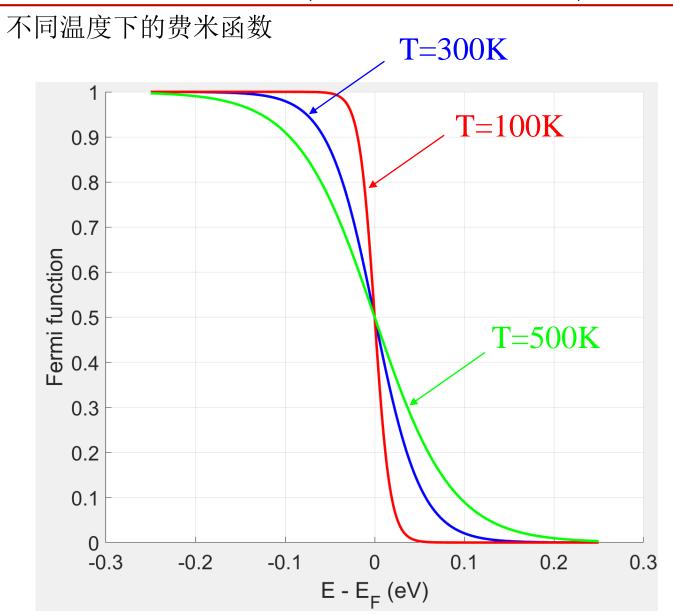
费米能级可以确定电子的统计学分布,但不一定对应一个允带中的能级

T = 0K



T > 0K



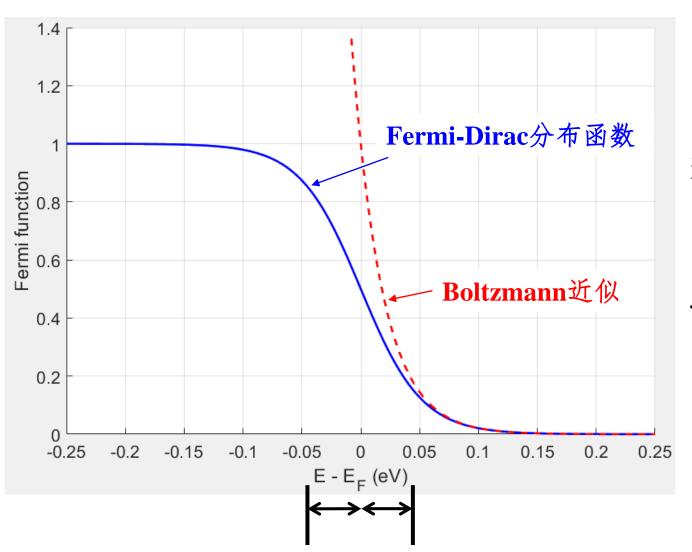


$$f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$





T=300K时, 电子的分布



当 
$$E - E_F > 3kT$$
 时:  $\exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right) >> 1$ 

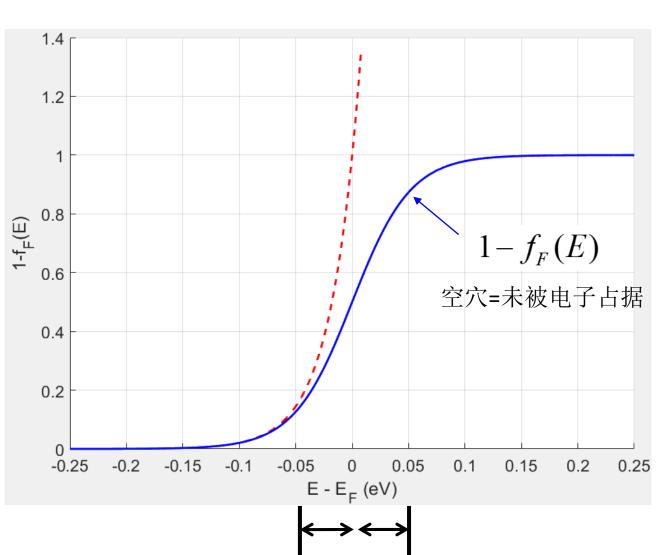
$$f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)} \approx \exp\left(-\frac{E - E_F}{kT}\right)$$

Fermi-Dirac分布

Boltzmann近似



T=300K时,空穴的分布



$$f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$

当 
$$E - E_F < -3kT$$
 时:  $\exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right) >> 1$ 

$$1 - f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E_F - E}{kT}\right)}$$

$$\approx \exp\left(-\frac{E_F - E}{kT}\right)$$

#### 费米-狄拉克分布



什么条件下才算 $E_F >> kT$ ?有效玻尔兹曼分布

$$T = 300K, E - E_F = 2kT$$

$$f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$

$$= \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{2kT}{kT}\right)}$$

$$= 11.9\%$$

$$\frac{\exp\left(-\frac{E - E_F}{kT}\right) - \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}}{\frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}} = 5\%$$

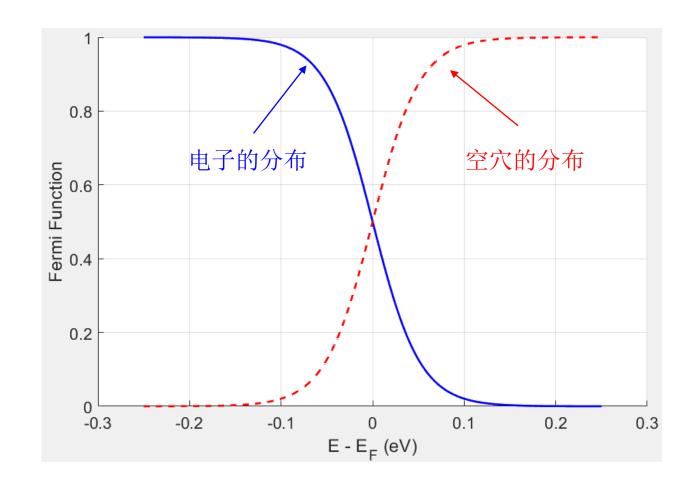
$$\exp\left(-\frac{E - E_F}{kT}\right) = 5\%$$

$$E - E_F = kT \ln\left(\frac{1}{0.05}\right) = 3kT$$

## 费米-狄拉克分布

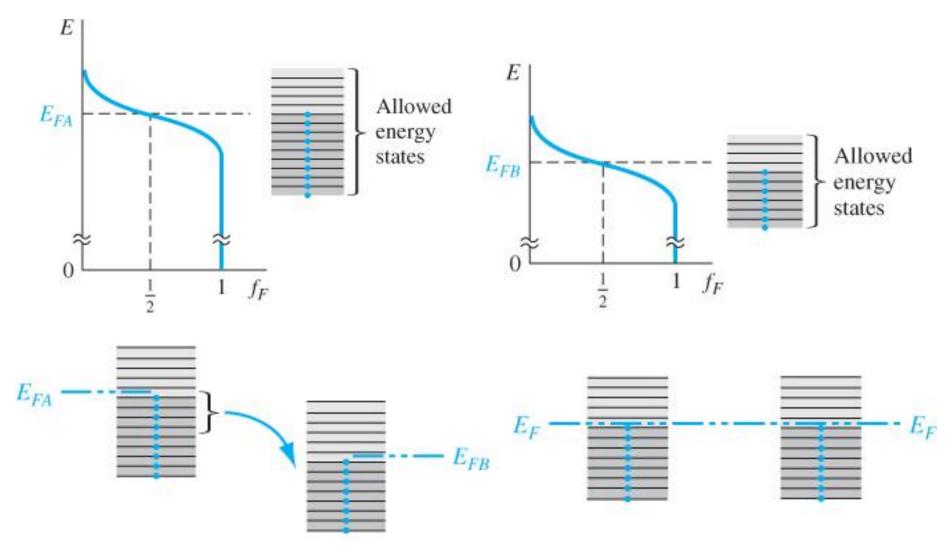


电子的分布和空穴的分布是什么关系?



#### 热平衡下两个系统





热平衡状态下整个系统的费米能级是一个常数

#### 费米-狄拉克分布小结



- 1) 费米能级 $E_{\rm F}$ 定义(化学势、占据概率50%)
- 2) 费米-狄拉克分布(T=0、T>0时, $E< E_F$ 、 $E> E_F$ 时概率情况)
- 3) 电子的分布函数、空穴的分布函数
- 4) 玻尔兹曼分布,有效玻尔兹曼近似
- 5) 热平衡下的两个系统拥有共同的费米能级

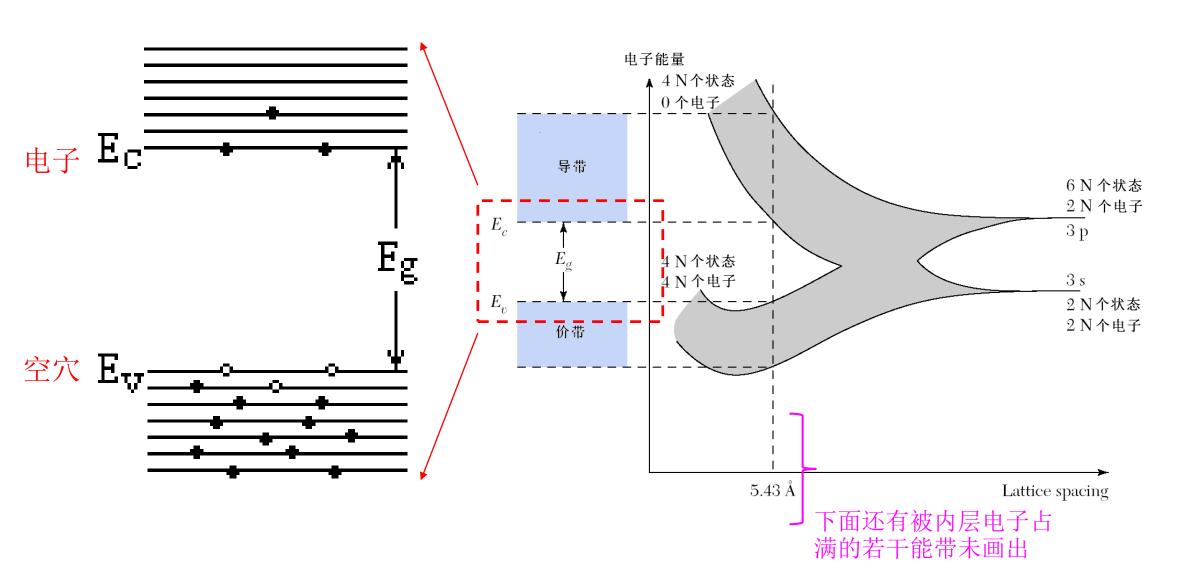


# 平衡半导体的载流子浓度 (本征半导体)

## 载流子浓度



什么是平衡半导体?





#### 导带态密度:

$$g_c(E) = \frac{4\pi (2m_n^*)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \sqrt{E - E_c}$$

#### 某一能级的量子态被电子占据的概率:

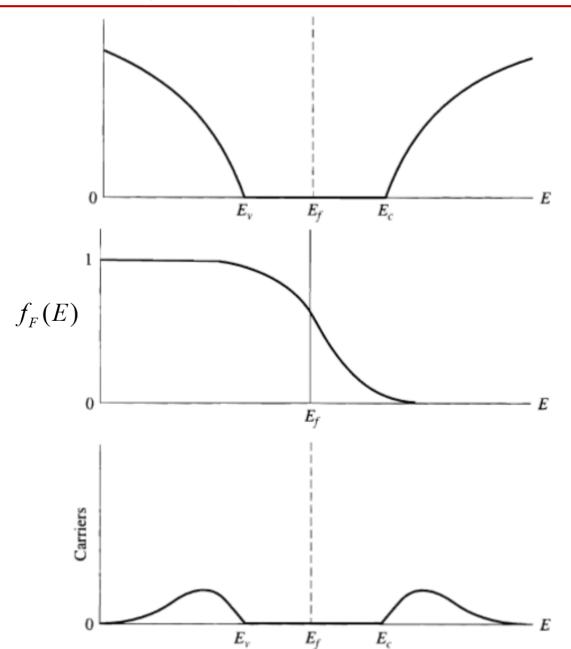
$$f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)} \approx \exp\left(-\frac{E - E_F}{kT}\right)$$

#### 导带中某一能级上的电子数:

$$n(E) = g_c(E)f_F(E)$$







$$g_c(E) = \frac{4\pi (2m_n^*)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \sqrt{E - E_c}$$

$$f_F(E) \approx \exp\left(-\frac{E - E_F}{kT}\right)$$

$$n_0 = \int_{E_c}^{E_{c-top}} n(E) dE$$

$$= \int_{E_c}^{E_{c-top}} g_c(E) f_F(E) dE$$

$$\approx \int_{E_c}^{\infty} g_c(E) f_F(E) dE$$



$$n_0 = \int_{E_c}^{\infty} g_c(E) f_F(E) dE$$

$$n_0 = \int_{E_c}^{\infty} \frac{4\pi (2m_n^*)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \sqrt{E - E_c} \exp\left(-\frac{E - E_F}{kT}\right) dE$$

$$= \frac{4\pi (2m_n^*)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right) \int_{E_c}^{\infty} \sqrt{E - E_c} \exp\left(-\frac{E - E_c}{kT}\right) dE$$

$$= \frac{4\pi (2m_n^*)^{\frac{3}{2}}}{h^3} (kT)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right) \int_{E_c}^{\infty} \sqrt{\frac{E - E_c}{kT}} \exp\left(-\frac{E - E_c}{kT}\right) d\left(\frac{E - E_c}{kT}\right)$$

$$= \frac{4\pi (2m_n^*)^{\frac{3}{2}}}{h^3} (kT)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right) \int_0^\infty \eta^{\frac{1}{2}} \exp(-\eta) \ d(\eta)$$



$$n_{0} = \int_{E_{c}}^{\infty} \frac{4\pi (2m_{n}^{*})^{\frac{3}{2}}}{h^{3}} \sqrt{E - E_{c}} \exp\left(-\frac{E - E_{F}}{kT}\right) dE$$

$$= \frac{4\pi (2m_{n}^{*})^{\frac{3}{2}}}{h^{3}} (kT)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_{c} - E_{F}}{kT}\right) \int_{0}^{\infty} \eta^{\frac{1}{2}} \exp(-\eta) d(\eta)$$

$$= \frac{4\pi (2m_{n}^{*}kT)^{\frac{3}{2}}}{h^{3}} \exp\left(-\frac{E_{c} - E_{F}}{kT}\right) \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$= \frac{2(2\pi m_{n}^{*}kT)^{\frac{3}{2}}}{h^{3}} \exp\left(-\frac{E_{c} - E_{F}}{kT}\right)$$

$$= \frac{N_{c} \exp\left(-\frac{E_{c} - E_{F}}{kT}\right)}{h^{3}} \exp\left(-\frac{E_{c} - E_{F}}{kT}\right)$$

$$N_{c} = 2\left(\frac{2\pi m_{n}^{*}kT}{h^{2}}\right)^{\frac{3}{2}} \propto \left(m_{n}^{*}\right)^{\frac{3}{2}}, T^{\frac{3}{2}}$$



$$n_0 = \int_{E_c}^{\infty} g_c(E) f_F(E) dE$$



$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right)$$

$$g_c(E) = \frac{4\pi (2m_n^*)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \sqrt{E - E_c}$$

$$f_F(E) \approx \exp\left(-\frac{E - E_F}{kT}\right)$$

$$N_c = 2\left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

导带的有效态密度: 把导带电子 等效的看作仅仅分布在导带底。

#### 导带中电子的热平衡浓度-习题



例 4.1 求导带中某个状态被电子占据的概率,并计算  $T=300~\mathrm{K}$  时硅中的热平衡电子浓度。设费米能级位于导带下方  $0.25~\mathrm{eV}$  处。  $T=300~\mathrm{K}$  时硅中的  $N_c=2.8\times10^{19}~\mathrm{cm}^{-3}$  (见附录 B)。

#### ■解

 $E = E_c + kT/2$  的量子态被电子占据的概率为

$$f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)} \approx \exp\left[\frac{-(E - E_F)}{kT}\right] = \exp\left[\frac{-(E_c + (kT/2) - E_F)}{kT}\right]$$

或

$$f_F(E) = \exp\left[\frac{-(0.25 + (0.0259/2))}{0.0259}\right] = 3.90 \times 10^{-5}$$

得到电子浓度为

$$n_0 = N_c \exp\left[\frac{-(E_c - E_F)}{kT}\right] = (2.8 \times 10^{19}) \exp\left[\frac{-0.25}{0.0259}\right]$$

或

$$n_0 = 1.80 \times 10^{15} \,\mathrm{cm}^{-3}$$



### 价带中态密度:

$$g_{\nu}(E) = \frac{4\pi (2m_{p}^{*})^{\frac{3}{2}}}{h^{3}} \sqrt{E_{\nu} - E}$$

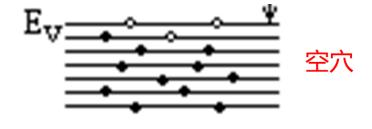
### 某一能级的量子态被空穴占据的概率:

$$1 - f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E_F - E}{kT}\right)}$$

$$\approx \exp\left(-\frac{E_F - E}{kT}\right)$$

### 价带中某一能级上的空穴浓度:

$$p(E) = g_v(E)[1 - f_F(E)]$$





$$p_{0} = \int_{E_{v_{\text{min}}}}^{E_{v_{\text{min}}}} p(E) dE$$

$$= \int_{E_{v_{\text{min}}}}^{E_{v_{\text{min}}}} g_{v}(E) \left[1 - f_{F}(E)\right] dE$$

$$\approx \int_{-\infty}^{E_{v}} g_{v}(E) \left[1 - f_{F}(E)\right] dE$$

$$E_{c_{\text{top}}}$$

$$E_{c_{\text{top}}}$$

$$E_{v_{\text{min}}}$$

$$g_{v}(E) = \frac{4\pi (2m_{p}^{*})^{\frac{3}{2}}}{h^{3}} \sqrt{E_{v} - E}$$

$$1 - f_F(E) \approx \exp\left(-\frac{E_F - E}{kT}\right)$$



$$\begin{split} p_{0} &= \int_{-\infty}^{E_{v}} \frac{4\pi (2m_{p}^{*})^{\frac{3}{2}}}{h^{3}} \sqrt{E_{v} - E} \exp\left(-\frac{E_{F} - E}{kT}\right) dE \\ &= \int_{-\infty}^{E_{v}} \frac{4\pi (2m_{p}^{*})^{\frac{3}{2}}}{h^{3}} \sqrt{E_{v} - E} \exp\left(-\frac{E_{F} - E_{v} + E_{v} - E}{kT}\right) dE \\ &= \frac{4\pi (2m_{p}^{*})^{\frac{3}{2}}}{h^{3}} \exp\left(-\frac{E_{F} - E_{v}}{kT}\right) \int_{-\infty}^{E_{v}} \sqrt{E_{v} - E} \exp\left(-\frac{E_{v} - E}{kT}\right) dE \\ &= -\frac{4\pi (2m_{p}^{*}kT)^{\frac{3}{2}}}{h^{3}} \exp\left(-\frac{E_{F} - E_{v}}{kT}\right) \int_{+\infty}^{0} \eta^{\frac{1}{2}} \exp\left(-\eta^{*}\right) d\eta^{*} \\ &= 2\left(\frac{2\pi m_{p}^{*}kT}{h^{2}}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_{F} - E_{v}}{kT}\right) \end{split}$$



$$g_{\nu}(E) = \frac{4\pi (2m_{p}^{*})^{\frac{3}{2}}}{h^{3}} \sqrt{E_{\nu} - E}$$

$$(E_{p} - E_{p})^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{h^{3}} (E_{p} - E_{p})^{\frac{3}{$$

$$1 - f_F(E) \approx \exp\left(-\frac{E_F - E}{kT}\right)$$

$$p_0 = \int_{-\infty}^{E_v} g_v(E) \left[ 1 - f_F(E) \right] dE$$

$$p_0 = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{kT}\right)$$

$$N_{v} = \frac{2(2\pi m_{p}^{*}kT)^{\frac{3}{2}}}{h^{3}}$$

价带有效状态密度:把价带空穴等效的看作仅仅分布在价带顶。

# 价带中空穴的热平衡浓度-习题



例 4.2 求 T=400 K 时硅的热平衡空穴浓度。

设费米能级处于价带能级上方  $0.27~{\rm eV}$  处。 $T=300~{\rm K}$  时,硅中的  $N_v=1.04\times10^{19}~{\rm cm}^{-3}$  (请参阅附录 B)。

#### ■ 解

T=400 K 时,参数值如下:

$$N_v = (1.04 \times 10^{19}) \left(\frac{400}{300}\right)^{3/2} = 1.60 \times 10^{19} \,\mathrm{cm}^{-3}$$

和

$$kT = (0.0259) \left(\frac{400}{300}\right) = 0.03453 \text{ eV}$$

得到空穴浓度为

$$p_0 = N_v \exp\left[\frac{-(E_F - E_v)}{kT}\right] = (1.60 \times 10^{19}) \exp\left(\frac{-0.27}{0.03453}\right)$$

或

$$p_0 = 6.43 \times 10^{15} \,\mathrm{cm}^{-3}$$

# 本征半导体



### 导带电子浓度:

$$n = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{kT}\right)$$

### 价带空穴浓度:

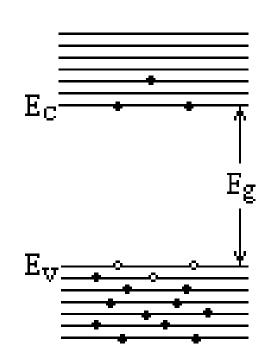
$$p = N_V \exp\left(-\frac{E_F - E_V}{kT}\right)$$

### 本征半导体:

$$n = p = n_i$$

$$N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{kT}\right) = N_V \exp\left(-\frac{E_F - E_V}{kT}\right)$$

$$E_F = E_i = \frac{E_C + E_V}{2} + \left(\frac{kT}{2}\right) \ln\left(\frac{N_V}{N_C}\right)$$



### 本征费米能级的位置



### 对本征半导体而言: $n_0 = p_0 = n_i$

$$n_0 = p_0 = n_i$$

$$n_0 = n_i = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_{Fi}}{kT}\right) , \quad p_0 = n_i = N_v \exp\left(-\frac{E_{Fi} - E_v}{kT}\right)$$

$$N_c \exp\left(-\frac{E_C - E_{Fi}}{KT}\right) = N_v \exp\left(-\frac{E_{Fi} - E_V}{KT}\right)$$

$$E_{Fi} = \frac{E_c + E_v}{2} + \left(\frac{kT}{2}\right) \ln\left(\frac{N_v}{N_c}\right) = \frac{N_c = \frac{2(2\pi m_n^* kT)^{\frac{3}{2}}}{h^3}}{N_v = \frac{2(2\pi m_p^* kT)^{\frac{3}{2}}}{h^3}}$$

$$E_{Fi} = \frac{E_c + E_v}{2} + \left(\frac{3}{4}kT\right) \ln\left(\frac{m_p^*}{m_n^*}\right)$$

# 本征费米能级的位置-习题



例 4.4 T=300 K 时, 计算硅中的本征费米能级相对于禁带中央的位置。 已知硅中载流子有效质量分别为  $m_n^*=1.08m_0$ ,  $m_p^*=0.56m_0$ 。

### ■解

本征费米能级相对于禁带中央的位置为

$$E_{Fi} - E_{\text{midgap}} = \frac{3}{4} kT \ln \left( \frac{m_p^*}{m_n^*} \right) = \frac{3}{4} (0.0259) \ln \left( \frac{0.56}{1.08} \right)$$

或

$$E_{Fi} - E_{\text{midgap}} = -0.0128 \text{ eV} = -12.8 \text{ meV}$$

# 热平衡载流子浓度

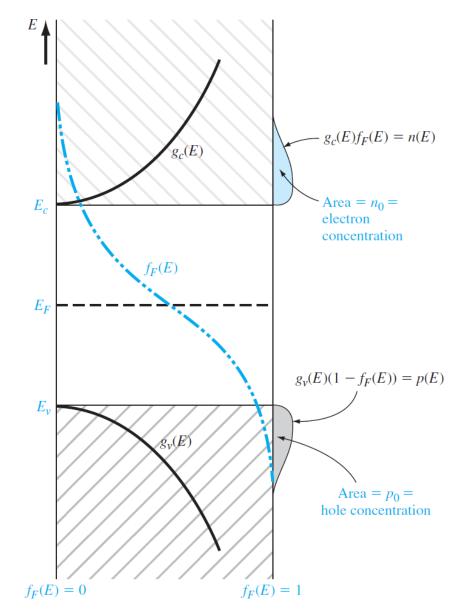


$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right)$$

Nc: 导带有效态密度

$$p_0 = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{kT}\right)$$

N<sub>v</sub>: 价带有效态密度

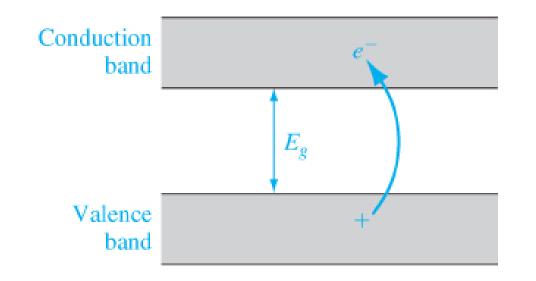


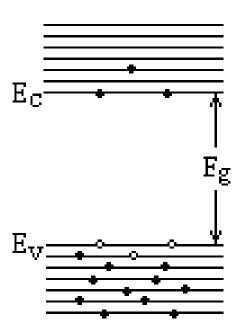
# 本征载流子浓度



◆在本征(intrinsic) 半导体中,导带中的电子浓度等于价带中的空穴浓度;

分别用 $n_i$ 、 $p_i$ 来表示;





◆由于 $n_i=p_i$ ,所以通常用 $n_i$ 来表示本征载流子浓度;

# 本征载流子浓度



- ◆在本征(intrinsic) 半导体中,导带中的电子浓度等于价带中的空穴浓度; 分别用 $n_i$ 、 $p_i$ 来表示;
- ◆由于 $n_i=p_i$ ,所以通常用 $n_i$ 来表示本征载流子浓度;
- lacktriangle本征半导体的费米能级称为本征费米能级, $E_F = E_{Fi}$

### 本征电子浓度:

$$n_0 = n_i = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_{Fi}}{kT}\right)$$

### 本征空穴浓度:

$$p_0 = n_i = N_v \exp\left(-\frac{E_{Fi} - E_v}{kT}\right)$$

# 本征载流子浓度



$$n_0 = n_i = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_{Fi}}{kT}\right) \qquad p_0 = n_i = N_v \exp\left(-\frac{E_{Fi} - E_v}{kT}\right)$$

$$n_0 p_0 = n_i^2 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_{Fi}}{kT}\right) \cdot N_v \exp\left(-\frac{E_{Fi} - E_v}{kT}\right)$$

$$\left(E_c - E_{Fi} + E_{Fi} - E_v\right)$$

$$=N_c N_v \exp\left(-\frac{E_c - E_{Fi} + E_{Fi} - E_v}{kT}\right)$$

$$=N_c N_v \exp\left(-\frac{E_g}{kT}\right)$$

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right)$$
 对于给定的材料( $E_g$ 一定),  
当温度恒定时( $T$ 固定), $n_i$ 为定值。

# 300K温度下本征载流子浓度



$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right)$$

### 半导体Si:

$$E_{g} = 1.12 \text{eV}$$

$$N_c = 2.86 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$$
;

$$N_{\rm v} = 1.04 \times 10^{19} {\rm cm}^{-3}$$

### 半导体GaAs:

$$E_{g} = 1.42 \text{eV}$$

$$N_c = 4.7 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$
;

$$N_v = 7.0 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$$

### 半导体Ge:

$$E_{g} = 0.66 \text{eV}$$

$$N_c = 1.04 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$$

$$N_v = 6.0 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$$

Table 4.2 | Commonly accepted values of  $n_i$  at T = 300 K

Silicon	$n_i = 1.5 \times 10^{10} \mathrm{cm}^{-3}$
Gallium arsenide	$n_i = 1.8 \times 10^6 \mathrm{cm}^{-3}$
Germanium	$n_i = 2.4 \times 10^{13} \mathrm{cm}^{-3}$

# 本征载流子浓度-习题



例 4.3 分别计算 T = 250 K和 T = 400 K时砷化镓中的本征载流子浓度。

 $T=300~{\rm K}$  时,砷化镓中的  $N_c=2.8\times 10^{19}~{\rm cm}^{-3}$ , $N_s=1.04\times 10^{19}~{\rm cm}^{-3}$ ,它们均与  $T^{3/2}$  成正比。设 砷化镓的禁带宽度为 1.12 eV,皆在此温度范围内不随温度变化。

#### ■ 解

由式(4.23), T=250 K时, 有

$$n_i^2 = (2.8 \times 10^{19})(1.04 \times 10^{19}) \left(\frac{250}{300}\right)^3 \exp\left[\frac{-1.12}{(0.0259)(250/300)}\right]$$
$$= 4.90 \times 10^{15}$$

因此

$$n_i = 7.0 \times 10^7 \,\mathrm{cm}^{-3}$$

T = 400 K 时, 有

$$n_i^2 = (2.8 \times 10^{19})(1.04 \times 10^{19}) \left(\frac{400}{300}\right)^3 \exp\left[\frac{-1.12}{(0.0259)(400/300)}\right]$$
$$= 5.67 \times 10^{24}$$

$$n_i = 2.38 \times 10^{12} \,\mathrm{cm}^{-3}$$

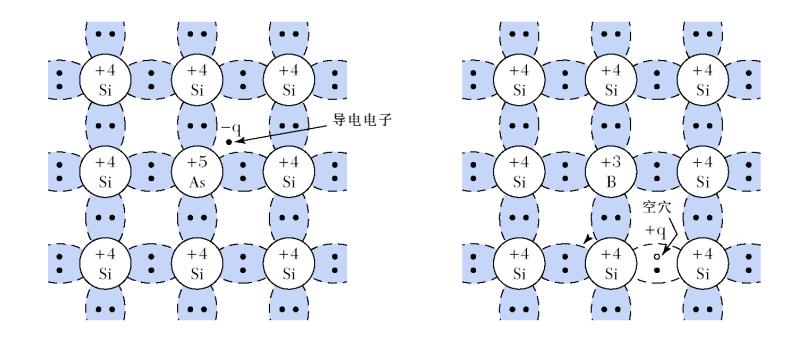


# 平衡半导体的载流子浓度 (非本征半导体)

# 非本征(Extrinsic)半导体

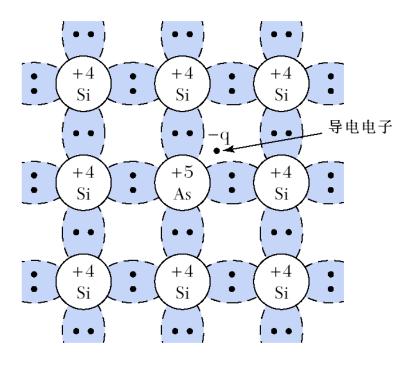


- ▶ 非本征半导体: 掺入杂质原子的半导体;
- > 掺入少量的的特定杂质原子,可以明显的改变半导体的电学特性;
- > 制造各种半导体器件的基础;

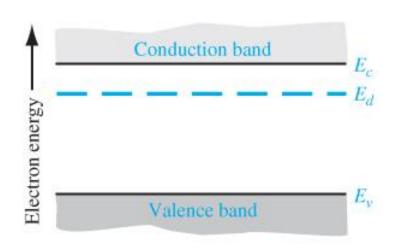


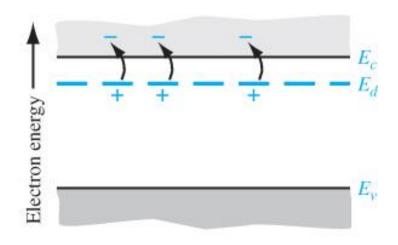
# n型半导体





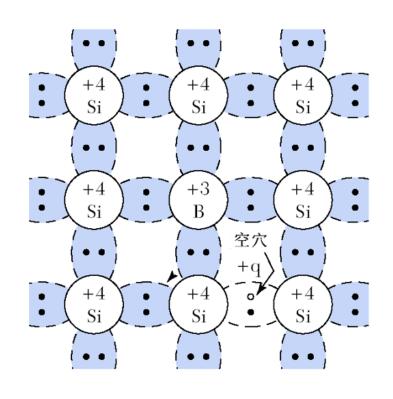
- □ 向导带贡献一个电子的杂质原子, 所以称为施主(Donor);
- □ 导带电子浓度高于价带空穴浓度, 此时的半导体称为n型半导体。



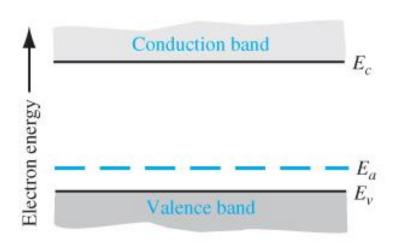


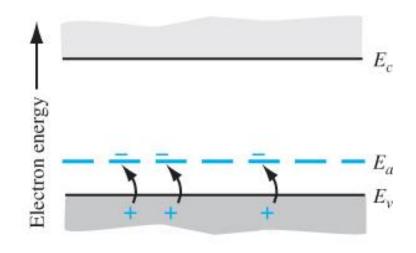
### p型半导体





- □ 从价带获得电子(向价带贡献一个空穴)的杂质, 所以称为受主(Acceptor);
- □ 价带空穴浓度高于导带电子浓度,此时的半导体称为p型半导体。





### 杂质离化能



### 波尔氢原子模型:

$$E_H = -\frac{m_0 q^4}{8\varepsilon_0^2 h^2 n^2} = -\frac{13.6}{n^2} \text{eV}$$

氢原子外只有一个电子且在第一轨道:

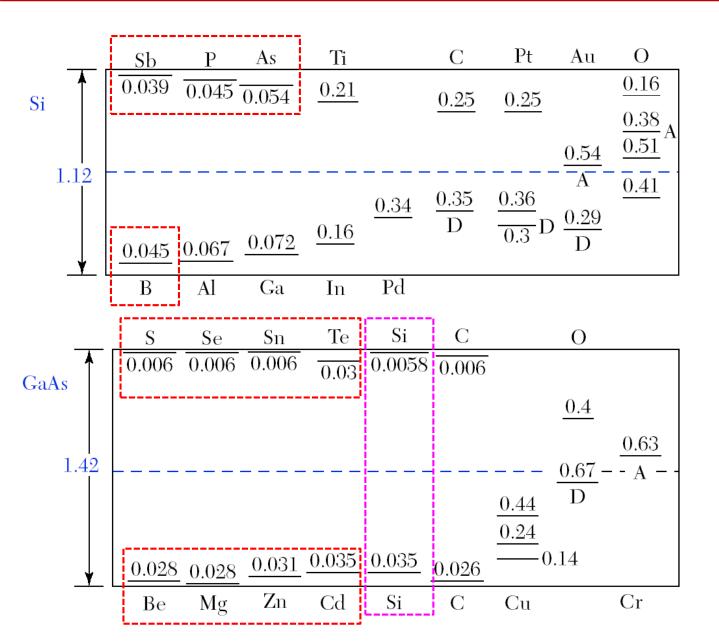
$$E_H = 0 - \left(-\frac{m_0 q^4}{8\varepsilon_0^2 h^2 n^2}\right) = \frac{13.6}{1} \text{ eV} = 13.6 \text{ eV}$$

施主杂质最外层一个电子在硅中电离,相当于在晶体中附加了一个氢原子:

$$E_D = \left(\frac{\mathcal{E}_0}{\mathcal{E}_S}\right)^2 \left(\frac{m_n^*}{m_0}\right) E_H \begin{cases} \text{ 健中为0.0258eV} \\ \text{GaAs 中为0.007eV} \end{cases}$$
(位算)

### 杂质离化能





#### GaAs:

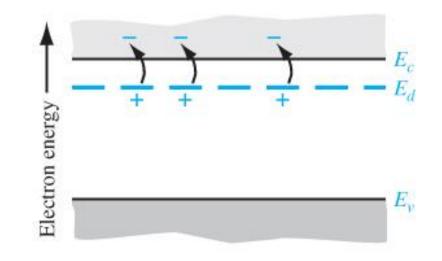
- ▶ II族元素为受主杂质
- ▶ VI族元素为施主杂质

课堂问题: 硅在砷化镓中是施主还是受主杂质?

### 施主杂质电离



$$f_F(E) = rac{1}{1+egin{pmatrix} 1 \ 2 \ exp{igg(rac{E_d-E_F}{kT}igg)} \ n_d = rac{1}{1+rac{1}{2}exp{igg(rac{E_d-E_F}{kT}igg)} \ N_d \ \end{pmatrix}}$$



$$n_d = N_d - N_d^+$$

### 受主杂质电离



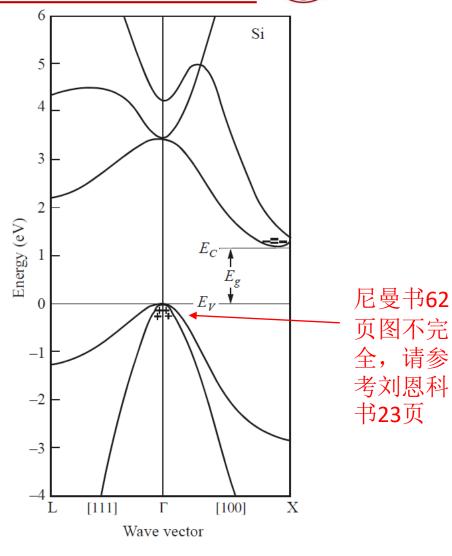
$$f_F(E) = \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{4} exp\left(\frac{E_F - E_a}{kT}\right)\right)}$$
受主能级简并因子

$$p_{a} = \frac{1}{1 + \frac{1}{4} \exp\left(\frac{E_{F} - E_{a}}{kT}\right)} N_{a}$$

$$p_a = N_a - N_a^-$$

占据受主能级的空穴浓度

硅的能带结构, k=0处存在两个简并的价带, 杂质能级也两重简并(g=2\*2=4)



### 未电离率



$$n_{d} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2} \exp\left(\frac{E_{d} - E_{F}}{kT}\right)} N_{d}$$

$$\approx 2 \exp\left(\frac{E_{F} - E_{d}}{kT}\right) N_{d}$$

$$\frac{n_d}{n_d + n_0} = \frac{1}{1 + \frac{N_c}{2N_d} \exp\left(-\frac{E_c - E_d}{kT}\right)}$$

 $n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right)$ 

# 未电离率-习题



例 4.7 试计算  $T=300~\mathrm{K}$  时施主能级中的电子数占据电子总数的比例。硅中的掺杂浓度为  $N_d=10^{16}~\mathrm{cm}^{-3}$ 。

#### ■ 解

利用式(4.55), 得

$$\frac{n_d}{n_0 + n_d} = \frac{1}{1 + \frac{2.8 \times 10^{19}}{2(10^{16})} \exp\left(\frac{-0.045}{0.0259}\right)} = 0.0041 = 0.41\%$$

#### ■说明

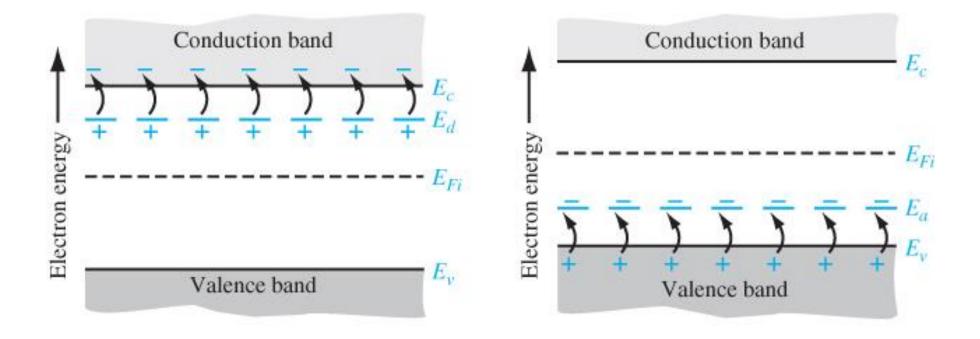
这个例题说明,与导带相比,施主能级中只有非常少的电子。施主能级中的电子基本上都进入了导带,仅有约0.4%的施主能级包含电子,因此施主状态称为完全电离。

$$\frac{n_d}{n_d + n_0} = \frac{1}{1 + \frac{N_c}{2N_d} \exp\left(-\frac{E_c - E_d}{kT}\right)}$$

### 杂质电离 (ionization)



### 室温条件下:



杂质完全电离

# 杂质电离

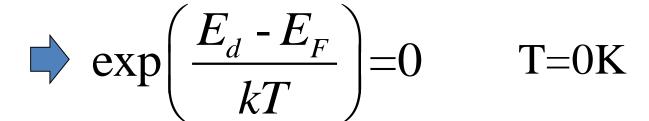


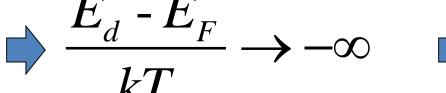
绝对零度时,所有电子都处于最低的可能能量状态;

n型半导体,每个施主能级都必须含有一个电子;

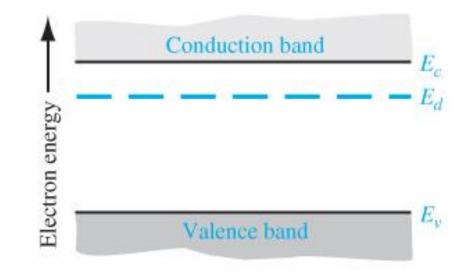
所以:  $n_d = N_d$ 

$$n_d = \frac{1}{1 + \frac{1}{2} \exp\left(\frac{E_d - E_F}{kT}\right)} N_d$$





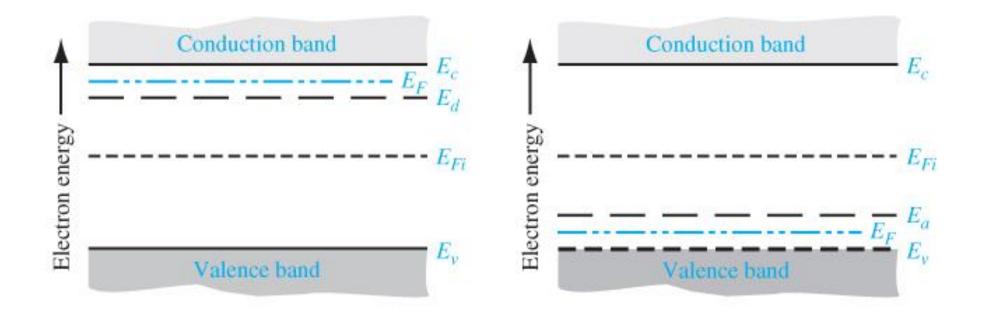




# 杂质电离

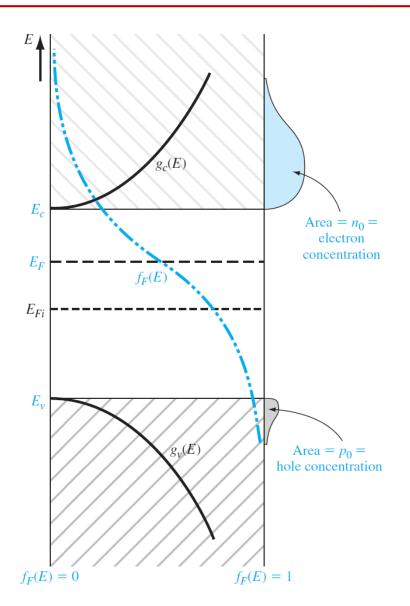


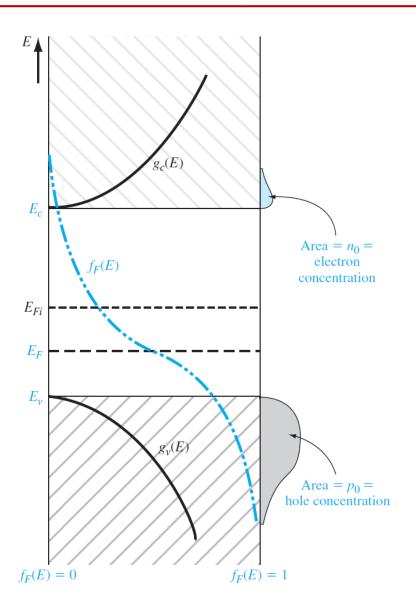
### 绝对零度时,费米能级 $E_{\rm F}$ 位置高于施主能级 $E_{\rm d}$ :



# 非本征半导体的热平衡载流子浓度







热平衡状态下电子和空穴浓度表达式:

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right)$$

$$p_0 = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{kT}\right)$$

本征和非本征半导体都适用!

费米能级高于本征费米能级

费米能级低于本征费米能级

# 非本征半导体的热平衡载流子浓度-习题



例 4.5 计算给定费米能级的热平衡电子浓度和空穴浓度。

假设  $T=300~{\rm K}$  时, 硅的参数为  $N_c=2.8\times10^{19}~{\rm cm}^{-3}$ ,  $N_s=1.04\times10^{19}~{\rm cm}^{-3}$ 。设费米能级比导带低 0.25 eV。若硅的禁带宽度为 1.12 eV,则费米能级比价带高 0.87 eV。

#### ■ 解

根据式(4.11)有

$$n_0 = (2.8 \times 10^{19}) \exp\left(\frac{-0.25}{0.0259}\right) = 1.8 \times 10^{15} \,\mathrm{cm}^{-3}$$

而根据式(4.19)有

$$p_0 = (1.04 \times 10^{19}) \exp\left(\frac{-0.87}{0.0259}\right) = 2.7 \times 10^4 \,\mathrm{cm}^{-3}$$

费米能级是一把尺子,它是杂质浓度的函数,费米能级的很小变化能使载流子浓度变化若干个数量级!

# 非本征半导体的特性



$$n_0 = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{kT}\right)$$

$$= N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_{Fi} + E_{Fi} - E_F}{kT}\right)$$

$$= N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_{Fi}}{kT}\right) \exp\left(-\frac{E_{Fi} - E_F}{kT}\right)$$

$$= n_i \exp\left(\frac{E_F - E_{Fi}}{kT}\right)$$

请推导空穴的表达式!

$$p_0 = n_i \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_F}{kT}\right)$$

# 非本征半导体的特性



 $n_0$ 和 $p_0$ 的乘积

$$n_0 = n_i \exp\left(\frac{E_F - E_{Fi}}{kT}\right)$$

$$p_0 = n_i \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_F}{kT}\right)$$

$$n_{0}p_{0} = n_{i} \exp\left(\frac{E_{F} - E_{Fi}}{kT}\right) \cdot n_{i} \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_{F}}{kT}\right)$$

$$= n_{i}^{2}$$

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right)$$

# 费米能级的位置



$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right) \qquad p_0 = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{kT}\right)$$

$$\left(E_c - E_F = kT \ln \left(\frac{N_c}{n_0}\right) \qquad E_F - E_v = kT \ln \left(\frac{N_v}{p_0}\right)\right)$$



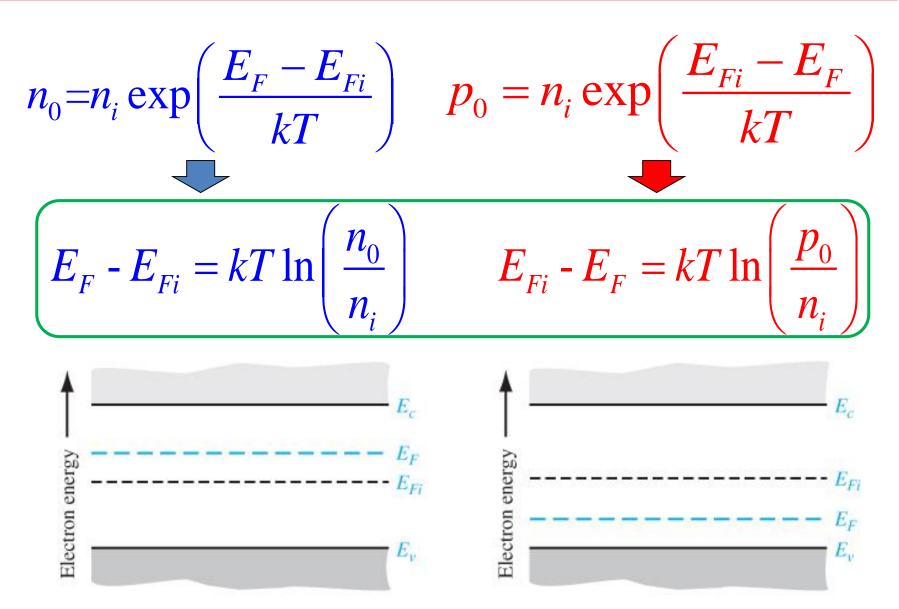
$$E_c - E_F = kT \ln \left(\frac{N_c}{N_d}\right) \qquad E_F - E_v = kT \ln \left(\frac{N_v}{N_a}\right)$$



$$E_F - E_v = kT \ln \left( \frac{N_v}{N_a} \right)$$

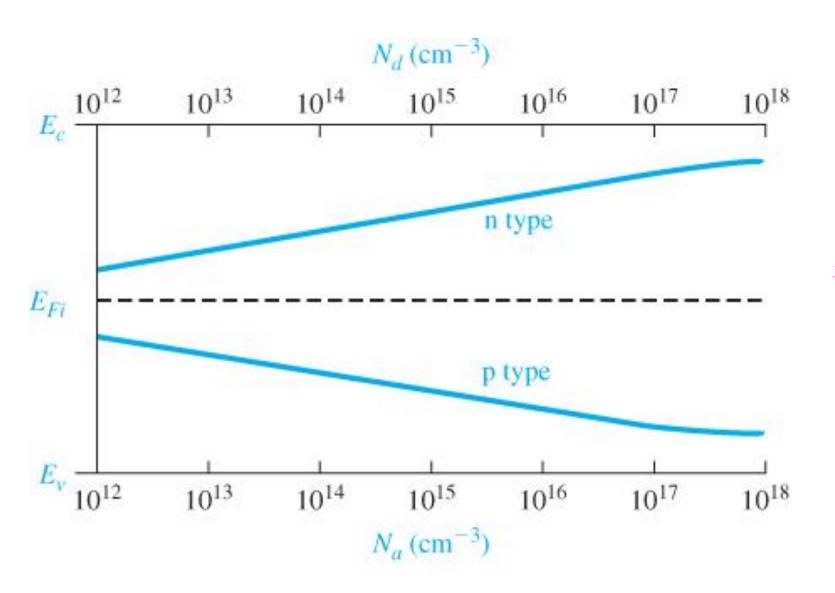
# 费米能级的位置





# 费米能级随掺杂浓度的变化





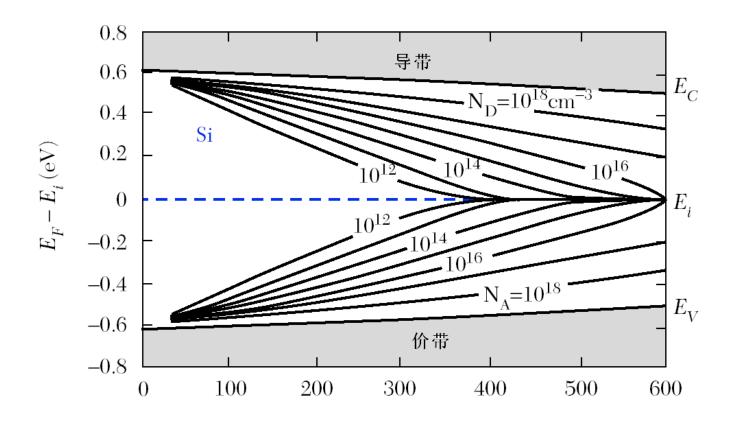
在玻尔兹曼近似成立的前提下推导得出!

### 费米能级随温度的变化



$$E_F - E_{Fi} = kT \ln \left( \frac{n_0}{n_i} \right)$$

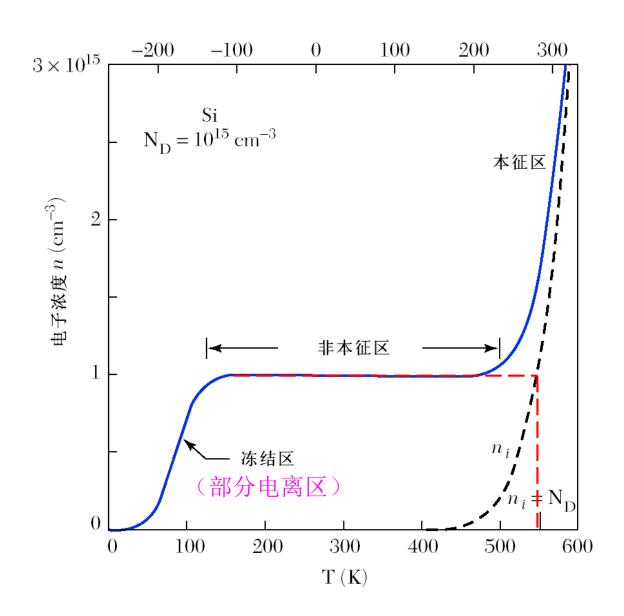
$$E_{Fi} - E_F = kT \ln \left( \frac{p_0}{n_i} \right)$$



$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right)$$

# 电子浓度随温度的关系

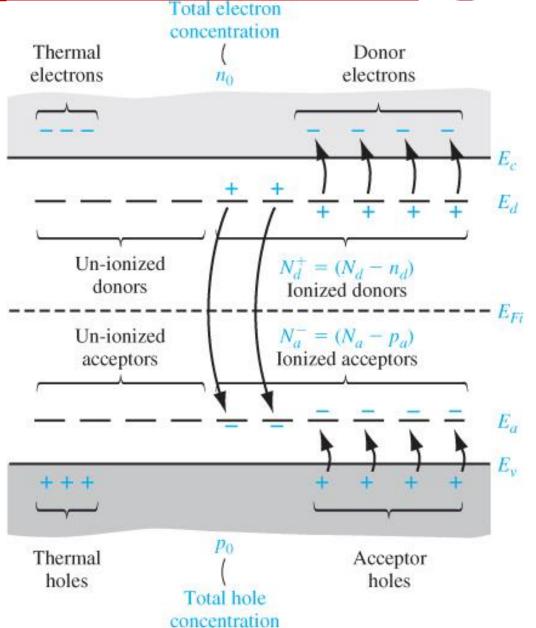




# 补偿半导体



补偿半导体:同一 区域内同时含有施 主和受主杂质的半 导体



# 补偿半导体



假设全电离: 
$$n_0 + N_a = p_0 + N_d$$

热平衡状态下: 
$$n_0 + N_a = \frac{n_i^2}{n_0} + N_d$$

$$n_0^2 + (N_a - N_d)n_0 - n_i^2 = 0$$

$$n_0 = \frac{N_d - N_a}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_d - N_a}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

### 补偿半导体



$$n_0 = \frac{N_d - N_a}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_d - N_a}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

$$\approx N_d - N_a \quad (室温下)$$

$$p_0 = \frac{N_a - N_d}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_a - N_d}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

$$\approx N_a - N_d \quad (室温下)$$

### 补偿半导体-习题



例 4.9 试计算给定掺杂浓度条件下, 热平衡电子的浓度和空穴的浓度。假设  $T=300~\rm K$ , (a)n 型硅掺杂浓度为  $N_d=10^{16}~\rm cm^{-3}$ 和  $N_a=0$ ; (b)  $N_d=5\times10^{15}~\rm cm^{-3}$ 和  $N_a=2\times10^{15}~\rm cm^{-3}$ 。

本征载流子浓度假定为  $n_i = 1.5 \times 10^{10}$  cm<sup>-3</sup>。

#### ■解

(a)根据式(4.60),多数载流子电子浓度为

$$n_0 = \frac{10^{16}}{2} + \sqrt{\left(\frac{10^{16}}{2}\right)^2 + (1.5 \times 10^{10})^2} \approx 10^{16} \,\mathrm{cm}^{-3}$$

少数载流子空穴浓度为

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{16}} = 2.25 \times 10^4 \,\mathrm{cm}^{-3}$$

(b)根据式(4.60),多数载流子电子浓度为

$$n_0 = \frac{5 \times 10^{15} - 2 \times 10^{15}}{2} + \sqrt{\left(\frac{5 \times 10^{15} - 2 \times 10^{15}}{2}\right)^2 + (1.5 \times 10^{10})^2} \approx 3 \times 10^{15} \,\mathrm{cm}^{-3}$$

少数载流子空穴浓度为

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{3 \times 10^{15}} = 7.5 \times 10^4 \,\mathrm{cm}^{-3}$$

### 简并半导体



### 当载流子浓度(掺杂浓度)高于导带或价带有效态密度时:

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right)$$

$$p_0 = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{kT}\right)$$

 $\rightarrow E_F$ 高于 $E_c$ 或低于 $E_v$ 

$$n_{0} \approx \int_{E_{c}}^{\infty} g_{c}(E) f_{F}(E) dE \quad , \quad g_{c}(E) = \frac{4\pi (2m_{n}^{*})^{\frac{3}{2}}}{h^{3}} \sqrt{E - E_{c}}$$

$$f_{F}(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_{F}}{kT}\right)} \approx \exp\left(-\frac{E - E_{F}}{kT}\right)$$

### 费米-狄拉克积分计算



### 如果波尔兹曼近似有效:

$$n_0 = \int_{E_c}^{\infty} \frac{4\pi (2m_n^*)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \sqrt{E - E_c} \exp\left(-\frac{E - E_F}{kT}\right) dE$$

### 如果波尔兹曼近似失效:

$$n_0 = \frac{4\pi (2m_{\rm n}^*)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \int_{E_c}^{+\infty} \sqrt{E - E_{\rm c}} \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_{\rm F}}{kT}\right)} dE$$

### 费米-狄拉克积分计算



$$n_0 = \frac{4\pi (2m_{\rm n}^*)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \int_{E_c}^{+\infty} \sqrt{E - E_{\rm c}} \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_{\rm F}}{kT}\right)} dE$$

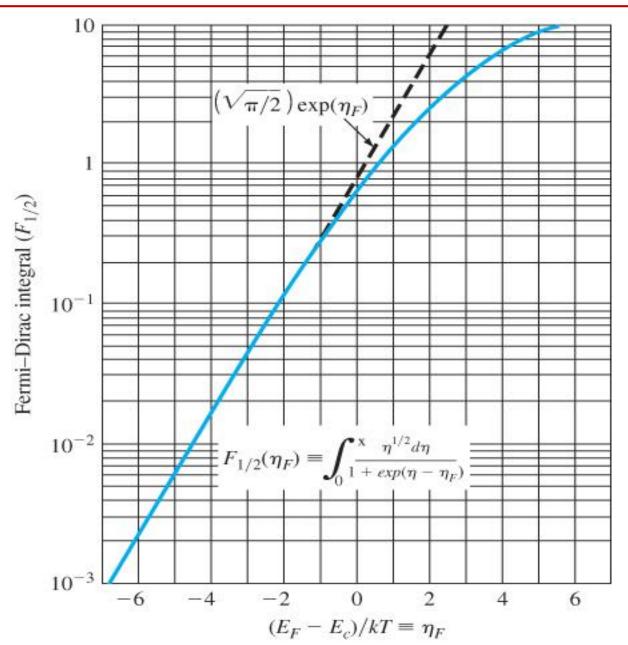
$$n_{0} = \frac{4\pi (2m_{n}^{*}kT)^{\frac{3}{2}}}{h^{3}} \int_{0}^{+\infty} \frac{\eta^{\frac{1}{2}}d\eta}{1 + \exp(\eta - \eta_{F})} \qquad \eta = \frac{E - E_{c}}{kT}$$

$$\eta_{F} = \frac{E - E_{c}}{kT}$$

$$F_{1/2}(\eta_F) = \int_0^{+\infty} \frac{\eta^{\overline{2}} d\eta}{1 + \exp(\eta - \eta_F)}$$
: 费米-狄拉克积分

# 费米-狄拉克积分计算

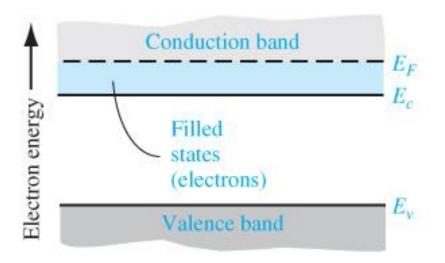


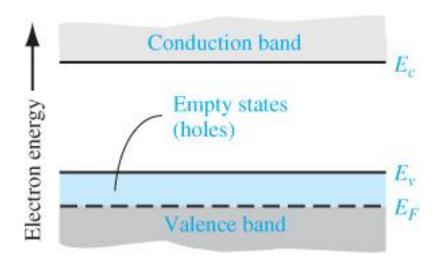


# 简并 (degenerate) 半导体



### 特点: 1) 载流子浓度高, 导电率接近于金属





# 非本征半导体的特性

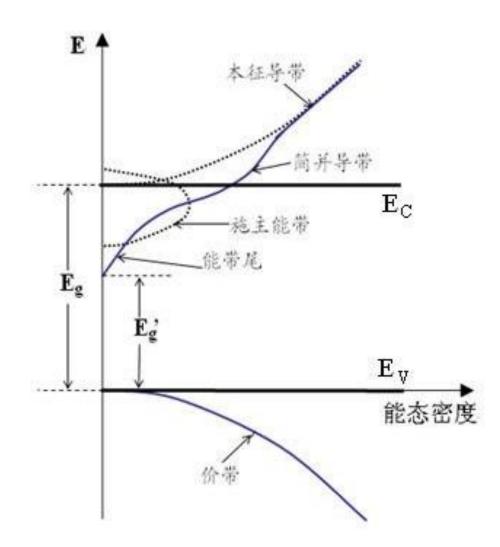


### 特点: 2) 禁带宽度变窄效应:

$$\Delta E_g = 22 \left(\frac{N}{10^{18}}\right)^{\frac{1}{2}} \text{ meV}$$

$$N \le 10^{18} \, \text{cm}^{-3}, \Delta E_g \le 0.022 \, \text{eV};$$

$$N \ge N_c = 2.86 \times 10^{19} \, \text{cm}^{-3}, \Delta E_g \ge 0.12 \, \text{eV};$$



### 热平衡载流子浓度小结



- 1) 状态密度、导带态密度 $g_c(E)$ 、导带有效态密度 $N_c$
- 2) 导带有效态密度 $N_c$ 和温度及有效质量 $\mathbf{m}^*_n$ 的关系
- 3) 费米狄拉克分布、玻尔兹曼近似(E- $E_F$ >3kT)
- 4) 热平衡
- 5) 热平衡载流子浓度 $n_0, p_0$ 
  - > Γ(3/2)函数
- 6) 本征费米能级 $E_{\rm Fi}$ 的位置
- 7) 本征载流子浓度n;
- 8) 本征半导体、非本征半导体
- 9) 离化能  $(E_a, E_d)$
- 10) 热平衡载流子浓度 $n_0$ ,  $p_0$ 的两种表达式( $E_{\rm F}$ 相对于 $E_{\rm C}$ 和 $E_{\rm Fi}$ 的位置)
- 11) 费米能级随掺杂浓度及温度的变化
- 12) 离化率 (常温、低温)、简并因子g
- 13) 电子浓度随温度的变化(部分电离区、非本征区、本征区)
- 14)补偿半导体
- 15) 简并半导体
  - ▶ 载流子浓度高,导电率接近金属
  - ▶ 禁带宽度变窄效应 (施主能级分裂为能带与导带底交叠)

$$n = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{KT}\right)$$

$$p = N_V \exp\left(-\frac{E_F - E_V}{KT}\right)$$

$$n_0 = n_i \exp\left(\frac{E_F - E_{Fi}}{kT}\right)$$

$$p_0 = n_i \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_F}{kT}\right)$$